#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-226027

(43)Date of publication of application: 07.09.1990

(51)Int.CI.

G01J 3/30 G01N 21/27

(21)Application number: 01-046154

(22)Date of filing:

01-046154 27.02.1989 (=4)4 # .

(71)Applicant:

HAMAMATSU PHOTONICS KK

(72)Inventor:

KOISHI YU

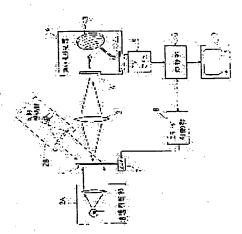
WATANABE MOTOYUKI

#### (54) SPECTROSCOPIC ANALYSER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To simply calculate the spectroscopic image of an object to be mea sured by forming the spectroscopic image of a line or spotlike spectroscopic objective region by a spectroscopic means and obtaining the intensity of light having a specific wavelength in the spectroscopic objective region by an intensity detection means.

CONSTITUTION: The light from an object 1 to be measured is detected by an image forming lens 3 and the optical image of the object 1 to be measured is formed on the incident surface 41 of a non-aberration spectroscope 4. The light transmitted through the incident slit preformed to the incident surface 41 is diffracted spectrally by a grating 43 and a spectroscopic image is formed on the emitting surface 44 of the non-aberration spectroscope 4 and taken by a TV camera 5 while the imaged data is sent to a processing part such as a computer. The object to be measured is made freely movable by an X-Y stage and the spectroscopic image of the object to be measured can be observed.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑫公開特許公報(A)

平2-226027

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月7日

G 01 J G 01 N 21/27

8707-2G 7458-2G Α

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全10頁)

60発明の名称 分光解析装置

> 願 平1-46154 20特

願 平1(1989)2月27日 22出

仰発 石 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

社内

元 之 明 個発

静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

社内

浜松ホトニクス株式会 願 人 包出

静岡県浜松市市野町1126番地の1

外3名 弁理士 長谷川 芳樹 理 人 砂代

#### 1. 発明の名称

分光解析装置

#### 2. 特許請求の範囲

被訓定物からの光を受光して光学像を形 成する結像手段と、前記光学像の1ラインまたは 1 点からなる分光対象領域を選択的に分光して分 光像を形成する分光手段と、前記分光像における 所定波長の光強度を検出する強度検出手段と、前 記分光対象領域を前記光学像の測定対象領域で移 動させる領域移動手段と、前記強度検出手段の出 力にもとづき前記測定対象領域内の前記所定波長 の光弦度分布を求める解析手段とを備えることを 特徴とする分光解折装置。

- 前記被測定物を照明する光顔を更に備え る請求項1記載の分光解析装置。
- 前記分光手段は無収差分光器からなる請 求項1記載の分光解析装置。

- 前記解析手段は前記光強度分布を表示す る表示手段を備える請求項1記載の分光解析装置。
- 前記被測定領域は前記光学なの二次元的 領域であり、前記表示手段は前記光学像の形状に 対応した二次元平面で光強度分布を表示する請求 項4記載の分光解析装置。
- 前記弦度校出手段は前記分光像における 1 波長もしくは複数波長の光強度を検出すること を特徴とする請求項1記載の分光解折装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被測定物の光学特性を特定の波長に着 目して解析する分光解析装置に関するものである。 〔従来の技術〕

従来、被測定物の分光解析にはフィルタが用い られていた。すなわち、光顔によって照明された 被測定物とTVカメラの間に、特定波長の光のみ を透過するフィルタを配設し、TVカメラの出力 から特定波長の光の二次元的画像を得ていた。

特開平2-226027(2)

(発明が解決しようとする課題)

そこで本発明は、被測定物の分光画像を所望の中心波長および波長幅で、簡単に求めることのできる分光解析装置を提供することを目的とする。 (理題を解決するための手段)

本発明に係る分光解析装置は、被測定物からの 反射、透過、発光あるいは整光等による光を受光 して光学像を形成する結像手段と、この光学像の 1 ラインまたは1点からなる分光対象領域を選択

的に解析することもできる。

(寒臟粥)

以下、添付図面を参照して本発明の実施例を説明する。

この分光像はTVカメラ5により撮像され、撮像データはコンピュータなどの処理部6に送られて後述の処理が施される。一方、彼別定物1はX

的に分光して分光像を形成する分光手段と、この分光像の分光対象領域における所定波長の光強度を検出する強度検出手段と、分光対象領域を光学像の測定対象領域で移動させる領域移動手段と、強度検出手段の出力にもとづき測定対象領域内の所定波長の光強度分布を求める解析手段とを編えることを特徴とする。

ここで、分光手段は無収差分光器からなるようにしてもよく、解析手段は光強度分布を二次元平 面で表示する表示手段を解えるようにしてもよい。 (作用)

本発明によれば、分光手段によってライは、分光手段によってが形式がないが形式がないが形式がないが形式がないできる。そして、一般域を受ける。そして、一般域を受けるのの光対ないは、解析手段にはないので、解析手段によっての観覚におけるを関すると、表示手段を設けるようにすれば、これを視覚

ーマステージ7によって移動自在になっており、このX-Yステージ7によって移動自在になって8によって調御されている。従って、X-Yステージ7による被測定物1の移動制御により、被測定を物1の定まる一次に同じないででは、では、では10の発出して2回を移10の発出により、に、第1回の装置における分光光学系の要部を、第2回を参照して説明する。

#### 特開平2-226027(3)

されて分光され、これによって出射面44に分光 なが形成される。

ここで、図中の被測定物1上の点Pa,Pi,Pe~は入射スリット42の点Pa,,Pi,,Pe~,に対応しており、この点Pa,,Pi,,Pe~,の分光像は出射面44のラインPa,, Pe~,の分光像は出射面44のラインPa,, Pi,,Pe~,に対応している。従って、被前のの光質は、そのy輪方向の大きまで出射面44に結像され、その故長ごとの光強度はy輪と直交する輪方向(~4時方向)で得られることになる。

次に、第1図および第2図の装置における分光 優の処理を、第3図を参照して説明する。

第 2 図に示す如く出射面 4 4 に形成された分光像は、 C C D カメラなどからなる第 1 図の T V カメラ5で爆像され、ビデオ信号は A / D 変換されて処理部 6 におけるイメージメモリに記憶される。第 3 図 (a) は M × N 画業の二次元イメージメモリに記憶された分光像の一例を示している。ここで、 N 画案の 3 軸 は 波 長に対応し、 M 画案の y 軸

移動させられる。すなわち、第1図の処理部6は ステージ制御部8に指令を与え、これによってス テージ制御郎8はX-Yステージフを駆動するこ とになる。すると、第2図に示す人射スリット 4 2 が x 軸方向に移動するので、先に示した x 方 向の位置 $\mathbf{x}_0$  とは異なる位置 $\mathbf{x}_1$  において、同様 の分光分析がされる。これにより、第3図(d) のイメージメモリ M  $_1$  , M  $_2$  , … M  $_n$  には、次の 位置x,での分光強度分布が格納される。以下、 同様の処理をx方向の全ての位置について実行す ると、イメージメモM<sub>1</sub> , M<sub>2</sub> , … M<sub>n</sub> には、波 長 <sup>入</sup> <sub>0</sub> . 入 <sub>1</sub> . ... 入 <sub>n</sub> の 分 光 弦 度 分 布 が 、 x - y の二次元平面において記憶される。このため、第 1 図の C R T 9 において、各波長  $\lambda_0$  .  $\lambda_1$  . ... 入。ことの分光画像を被測定物1と同一の二次元 平面で表示できることになる。

ここで、分光器として無収差分光器4を用いるこことの有用性を、第4図により簡単に説明する。

例えば第4図 (a) のような分光スペクトルを 持つ光を、分光器の人射スリット42に入射する は被測定物 1 のライン 2 における y 方向位置に対応している。このイメージメモリの光強度情報長  $\lambda_1$  、  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_n$  、 被  $\lambda_1$  、  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_n$  、 被  $\lambda_1$  、  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_n$  で  $\lambda_1$  な  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_n$  で  $\lambda_1$  な  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_1$  の  $\lambda_2$  、 …  $\lambda_2$  の  $\lambda_3$  の  $\lambda_4$  の  $\lambda_4$  の  $\lambda_4$  の  $\lambda_5$  を  $\lambda_5$  の  $\lambda_5$  を  $\lambda_5$  の  $\lambda_5$  を  $\lambda_5$  の  $\lambda$ 

なお、上記説明においてテレビカメラ5の必要なところ(つまり、 λ<sub>1</sub> ± Δ λ<sub>1</sub> / 2 のところ)のみを走査し、各波長毎にビデオ信号を積分する
等した後 A / D 変換し、直接イメージメモリ M<sub>1</sub> ~ M<sub>n</sub> に格納しても良い。

以上の処理が終了すると、一次元的な分光対象領域が二次元的な広がりを有する測定対象領域で

と、従来の分光器では出射面44での分光像が同図(b)のようになる。すなわち、分光出力像に歪みとボケが生じてしまう。これに対し、無収差分光器を用いると、同図(c)の如く出力像に歪みやボケは現れない。すなわち、入射スリット42に光が入射する位置Q0、Q1、Q2により出力像が歪むことがなく、また波長軸(入軸)と直交する軸(空間軸)の分解能も向上する。

次に、第5図を参照して本発明の第2実施例を 説明する。

第5図はその要部を示す構成図である。そして、これが削述の第1実施例と異なる点は、入射面41にはスリットではなく、入射ピンホールPが設けられ、これによって点状の分光対象領域が設定されていることである。そして、これに対応してTVカメラに変えて(TVカメラでもよい)一次元のラインセンサ51が出射面44に対向して設けられていることである。この実施例によれば、被削定物1の座標(xo、yo)の点Pの光学像は入射面41の入射ピンホールPに形成され、こ

特開平2-226027 (4)

れがグレーディング 4 3 で分 光 されて 出射 正 4 4 4 7 で分 光 像 が 形成 される。 この分 光 像 の 光 光 像 で は み り に な 及 ご と に ボ な り られて 処理 部 6 1 で ディン メ モ り 6 2 で で い な り に な る の ライ ン メ モ り 6 2 で に 額 定 な れ る。 で な み り られて 光 強 度 で れ な か か な モ り が こ で な り か れ た 光 強 で で な り か か な ー と な が に 低 を な 入 」 、 な る 入 」 、 な し と メ ら で な び が な り が こ で な び が れ の で に は 光 強 度 の か な ア で ほ け か な で り が な で り が な で り が な で り が な で り が な で り が で し と と な が で り が な で り が で で は 光 強 度 の で な び が な で り が な で り が な で り が な で り が な で り が な で で な が な で り が な で と に な る 。

以上の処理を被測定物 1 の点 P ( x 0 , y 0 )について行なったら、 x - y ステージにより 被測定物 1 を移動させ、分光対象領域を x - y 方向に走査して同様の処理を行なう。すると、処理部 6 のイメージメモリ M 1 , M 2 , … M n には、第 1 実施例と同様の光強度分布が記憶される。従って、C R T 9 によって分光画像を表示することができ

51を波長軸(入軸)方向に走査して結果をイメージメモリM<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, … M<sub>n</sub> に記録すれば、被制定物1のライン2′における光強度が、 y 軸方向の位置情報を保持したままで波長ごとに記録できる。よって、第1実施例と同様に被測定物1を移動させて上記の処理を繰り返せば、二次元平面で分光画像を規測できる。

第7 図は上記第6 図の第3 実施例に係る変形例の要部を示している。

 次に、第6図を診照して本発明の第3実施例を 説明する。

第6回はその要部構成図である。そして、これ が第1実施例と比較して特徴的なことは、無収差 分光器4の出射面44の前面に、波長軸( λ 軸 ) に直交するスリット幅が可変なスリット44<sub>ss</sub>を 有する出射スリット板44<sub>m</sub>が設けられ、このス リット44<sub>ss</sub>に対向してラインセンサ51が設け られていることである。この実施例によれば、無 収益分光器4により形成される分光像は第1実施 例のものと同様であるが、無収差分光器4の出射 面44には上記のスリット44<sub>ss</sub>があるので、特 定波县の光のみがラインセンサ51に届くことに なる。従って、出射側のスリット44。この入軸方 向の中心位置によってラインセンサ51で検出さ れる中心波長が定まり、スリット44ggの幅を変 える事により検出される波長幅を任意に定められ ることになる。

このため、スリット44<sub>ss</sub>およびラインセンサ

によれば、3つの異なる波長の光を同時に検出し、 これを処理部(図示せず)に送って処理すること ができる。

第 7 凶 (b) の例では、1 個のラインセンサ5 1 が設けられ、これがスライドボックス5 3 の作用により矢印A方向に移動可能になっている。この例によれば、ラインセンサ5 1 をそれぞれスリット 4 4 sa~4 4 scの位置に移動設定することで、異なる波長の光を設出することができる。

第7図(c)の例では、分光器の結像面444に 結像された分光像をリレーするレンズ544と、このレンズ54からの光を反射させる回転ミラー55、及びスリット幅可変なスリット57を有するスリット版58を領える。この例によれば、回転ミラー55を軸56を中心に回転させることをラインセンサ51に44からの光をスリット57を近過した光を入射できる。

本発明は上記の実施例に限定されることなく、 種々の変形が可能である。

### 特開平2-226027 (5)

例えば、被削定物 1 を照明する透過型あるいは 反射型の光額は必須ではなく、被削定物 1 が発光 性あるいは螢光性の物体であるときは、無光颜と できる。また、光顔を用いるときは、キセノンラ ンプ等の白色顔のほか、レーザ光顔を用いてもよ

#### (発明の効果)

以上、詳細に説明した通り本発明では、分光手

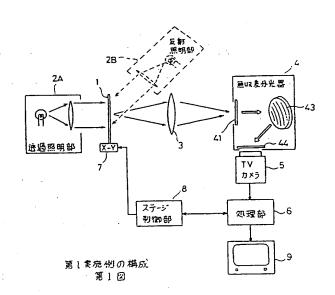
実施例の要部説明図、第7図は第3 実施例の変形 例を示す図、第8 図は本発明の変形例の説明図、 第9図は分光画像解析の説明図である。

1 … 被 訓 定物、 2 … 光 额、 3 … 結 像 レンズ、 4 … 無 収 差 分 光 器 、 5 … T V カメラ、 6 … 処 理 郎、 7 … X - Y ステージ、 8 … ステージ 制 御 部 、 4 1 … 入 射 面 、 4 2 … 人 射 スリット、 4 4 … 出 射 面 、 5 1 … ラインセンサ。

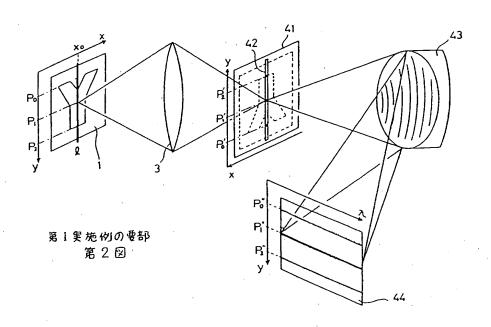
特許出願人 浜松ホトニクス株式会社 代理人弁理士 長谷川 芳 樹 本発明の分光解析装置は、生物、物理、化学等の基礎研究をはじめ、工業製品の検査等の幅広い分野に応用できる。

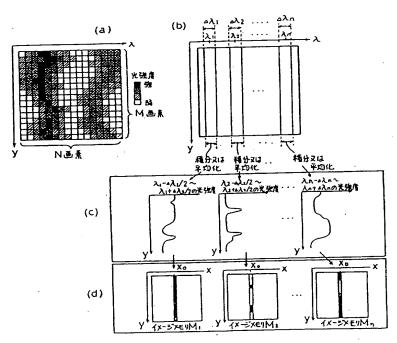
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る分光解析装置の第1実施例の構成図、第2図は第1実施例の要部説明図、第3図は第1実施例における分光像の処理を説明する図、第4図は無収差分光器の特色を示す図、第5図は第2実施例の要部説明図、第6図は第3



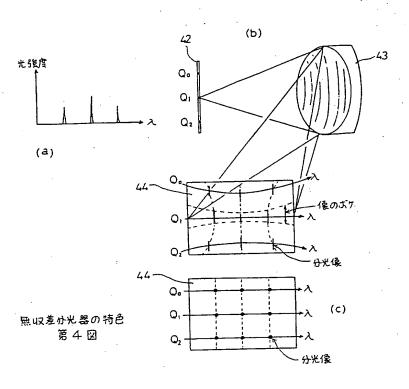
## 特間平2-226027 (6)

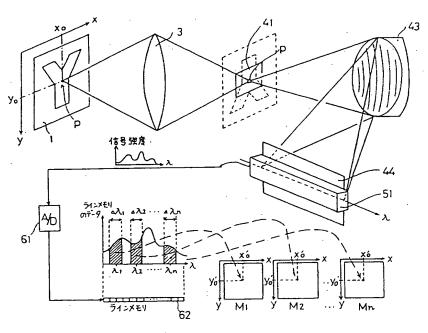




第1実焼例における分光像の処理 第 3 図

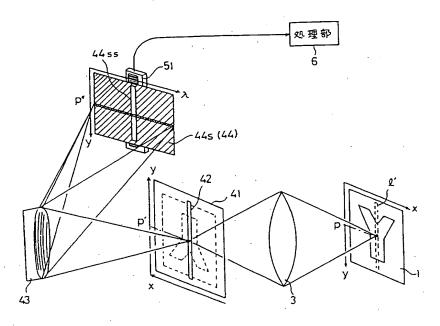
# 特別平2-226027 (7)



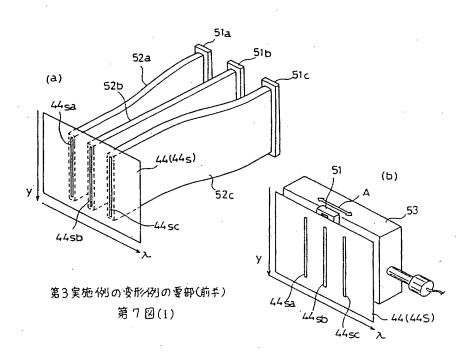


第2実施例の構成 第5図

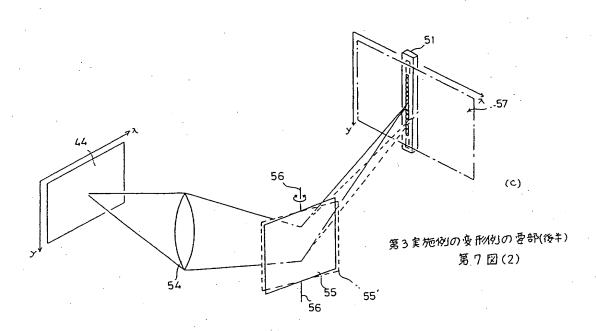
# 特開平2-226027 (8)

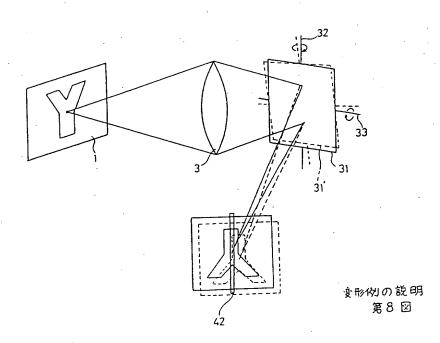


第3実施例の要部 第6図

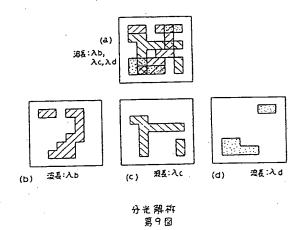


# 持開平2-226027 (9)





特開平2-226027 (10)



-<u>.</u>210-

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
$\square$ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.